

G01 測定；試験

注

(1) このクラスは“真”の測定計器のほかに類似構造の他の指示表示装置又は記録装置を含み、また更に、信号化装置又は制御装置についてはそれが測定に関するものであって（以下の注（2）で定義するように）特定の信号化目的または特定の制御目的に特に適合しないものである限り、含まれる。

(2) このクラスにおいては、下記の用語は以下に示す意味で用いる：

“測定”はその第一義の意味又は基本的な意味よりもかなり広い意味を含むものとして用いる。この語の第一義的な意味においては、変量値を単位もしくはデ・タに関して又は同じ性質の別の変量に関して数値的に表現することを見出すこと、例えば長さをスケ・ルで測定することある長さを別の長さの表現で表わすこと、を意味する。この変量値は直接的に得る（すぐ前で言及したように）こともあり、また、水銀柱の長さの変化を測定することにより温度変化を測定するなど求める変量値に関連づけることのできる他の変量値を測定することによって得ることもある。しかしながら、同じ装置又は計器が、直接的な表示を行う代りに、記録をとったり、指示効果又は制御効果を奏すべく信号を発生するために用いられ、或いは、他の装置又は計器と組み合わせて同種又は異種の二以上の変量の測定から一つのまとまった結果を得るために用いられることもあるので、“測定”はかかる数値的表現を変量を数値に変換する何らかの手段の付加的使用によって得ることを可能とするような操作をも含むものとして解釈することが必要である。従って、数値での表現は実際的にはデジタル的表現によって行なうこともありスケ・ルを読むことによって行なうこともあり、また、その指示は数値を用いないで、例えば測定されている変量が特性又は状態であるところの実在物（例、物体、物質、光ビ・ム）について感知し得る何らかの特性（変量）によって又はそのような特性に類似するもの（例、スケ・ルをもたない部材の対応位置、何らかの手段によって発生される対応電圧）によって、与えられることがある。

また、上記のような変量値指示が行なわれずに単に基準又はデ・タ（その値は数値的に既知のこともあり未知のこともある）に関しての異同を示すだけのことも多くある。この基準又はデ・タは同一性質であるが異なる実在物（例、標準器）の値のこともあり、或いは異なる時点での同一実在物の値であることもある。その最も単純な形態においては、測定は単にある状態又は性質、例えば運動（いずれかの方向又は特定の方向における）の有無を指示するだけのこともあるし、また、変量が既定値を超えるかどうかを指示するだけのこともある。

(3) “マイクロ構造の装置”および“マイクロ構造のシステム”に関する、クラス B81 およびサブクラス B81B の両タイトルの後の注に注意すること。[7]

(4) セクション G のタイトルに続く注、特に“変量”という用語の定義については注意はすること。

(5) 多くの測定装置において、測定すべき第一の変量は第二の変量またはさらなる変量に変換される。第二の変量またはさらなる変量は、第一の変量に関係して構成部材に生じた状態、または構成部材の変位であるかもしれない。そして、さらに変換が必要となるかもしれない。

[6]

このような装置を分類するときは、(i) 重要である特定の変換ステップ、または重要である個々の変換ステップを分類するか、または (ii) 全体としてのシステムのみが重要な場合は、第一の変量を該当する箇所に分類する。[6]

これは2つ以上の変換が起こる場合に特に重要である。たとえば、第一の変量（例、圧力）が第二の変量（例、感知体の光学的特性）に変換され、さらにその第二の変量が第三の変量（例、電気的效果）で示されるような場合である。このような場合には、次の分類箇所を考慮しなければならない：

第一の変量の変換についての分類場所、その変量により生じた状態を感知することについての分類場所、測定を示す G01D、そして最後に、該当する場合は、システム全体を分類する場所である。[6]

(6) 物理的特性の値の変化の測定は、その物理的特性の測定と同一のサブクラスに分類する。例えば、長さの伸びの測定はサブクラス G01B に分類する。

G01B 長さ、厚さまたは同種の直線寸法の測定；角度の測定；面積の測定；表面または輪郭の不規則性の測定

注

1. このサブクラスは長さまたは角度（linear or angular dimension）で表現された位置または変位の測定を包含する。

2. このサブクラスにおいては、グル・ブはもっとも重要な測定技術により分類されている。したがって、最終指示を与えるための他の技術または手段の単なる適用は、分類には影響しない。

3. クラス G01 のタイトルに続く注に注意すること。

4. このサブクラスに記述された手動装置と同一の原理で作動する機械は、これらの各装置のところに分類する。

5. グル・ブ G01B3/00-G01B17/00 までの2つ以上のグル・ブに包含される測定装置またはその細部は、他のグル・ブの中から1つも優先的な分類先が選択できない場合はグル・ブ G01B21/00 に分類する。

サブクラス内の索引

物質によって特徴づけられた測定装置..... 1/00

測定に使用されている主要な技術

機械的なもの..... 3/00,5/00

電気的または磁氣的なもの..... 7/00

流体によるもの..... 13/00

光学の..... 9/00,11/00

光以外の電磁波によるもの；粒子性放射線によるもの..... 15/00

音波によるもの..... 17/00

他の測定装置..... 21/00

1/00 材質の選択に特徴のある測定計器

1/00 101

・線度器

A 剛性のもの

Z その他のもの

3/00 機械的技術の使用によって特徴づけられた測定計器 [2006.01]

このグル・ブに分類する場合、特定のパラメ・タを測定するための機械的装置は、さらにグル・ブ G01B5/00 に分類することができる。

3/02 ・直読用の目盛またはマ・クをもつ定規またはテ・ブ

3/04 ・剛性のもの

3/06 ・折りたたみ式

3/08 ・伸長式

3/10 ・巻尺 [2020.01]

3/1003 ・構造または素材に特徴があるもの；レイアウトまたはしるしの表示に特徴のあるもの [2020.01]

3/1005 ・テ・ブの巻き上げ、または巻き戻しを制御する手段 [2020.01]

3/1007 ・固定する手段 [2020.01]

3/102 ・制動する手段 [2020.01]

3/1041 ・ケ・シングに特徴があるもの [2020.01]

3/1043 ・その内部構造の詳細、例、個別に成形されたケ・シング半体を連結する手段 [2020.01]

3/1046 ・その外部構造の詳細、例、確実にしっかりと保持するための形状 [2020.01]

3/1048 ・取り付けるため、または保持するために、一体化された手段 [2020.01]

3/1056 ・テ・ブの終端に設けられる工夫 [2020.01]

3/1061	・測長結果の数値を表示するための、または数値の読み取りを支援するための手段 [2020.01]	3/44	・摩耗と公差のために調整できるもの
3/1069	・電子的または機械的表示装置 [2020.01]	3/46	・一定間隔で面に係合する内径用のプラグゲージ、ただし、調整できるものも含む
3/1071	・巻尺を保持するための、または固定するための別個の手段 [2020.01]	3/48	・めねじ用
3/1084	・測長以外の機能を達成するための工夫が設けられたテーパー [2020.01]	3/50	・リミットゲージ型のもの、すなわち " はめあい式 " (G01B3/48 が優先)
3/1089	・マスキング、描画、または切断するためのもの [2020.01]	3/52	・摩耗と公差のために調整できるもの
3/1092	・測長と、少なくとも1つの性質の異なる他の測定を実施するためのもの、例：気泡式水準器 [2020.01]	3/56	・角度またはテーパー測定用ゲージ、例：円錐カリパス
3/1094	・情報を記録するための、または計算を実施するためのもの [2020.01]	5/00	機械的技術の使用によって特徴づけられた測定装置 [2006.01]
3/11	・測長用のくさり	A	位置の測定；変位量の測定
3/12	・測定ホイール	B	・変位測定用プロブ (5/012,5/016 が優先)
3/14	・輪郭チェック用の型板	F	・中心位置の測定 (軸の心合わせ検査は5/25)
3/16	・コンパス、すなわち一對のピボットアームをもつもの	L	測定手段又は測定対象物を支持、固定するための基台、テーパー；その微動機構
3/18	・マイクロメータ	P	測定手段の検査、校正
3/18 101	・内側測定用	R	鉄道軌条測定用
3/18 102	・外側測定用	S	鉄道架線測定用
3/20	・スライドゲージ	T	路面測定用
A	深さ測定用	U	体位測定用
B	高さ測定用	W	摩耗量の測定
C	穴中心間距離測定用	Z	その他のもの
D	輪尺	このグループに分類する場合、特定の機械的測定計器はさらにグループ G01B3/00 に分類することができる。	
E	溶接ゲージ		
Z	その他のもの	5/004	・点の座標測定用 [6]
3/20 101	・ノギス	5/008	・座標測定機械を使うもの [6]
A	副尺目盛を有するもの	5/012	・そのための接触子ヘッド [6]
B	副尺目盛以外の読取り手段を有するもの	5/016	・接触子の構造細部 [6]
Z	その他のもの	5/02	・長さ、幅または厚測定用 (G01B5/004, G01B5/08 が優先) [6]
3/22	・フィラピンゲージ、例：ダイヤルゲージ (輪郭または曲率測定用 G01B5/20)	5/02 101	・曲線に沿った長さの測定用
A	レバ式	5/04	・移動体の長さまたは幅測定用に特に適合したもの
B	ベルト式	5/04 101	・移動方向に沿った移動体の長さ測定用
C	ラック式	5/06	・厚み測定用
P	検査	5/06 101	・移動体の厚さ測定用
Q	防塵	5/08	・直径測定用
R	温度補償	5/10	・移動体の
Z	その他のもの	5/12	・内径
3/24	・オプンヨーク付き、すなわちカリパス	5/14	・離隔対象物または離隔開口間の距離または間隙測定用 (G01B5/24 が優先)
3/26	・プラグゲージ	5/16	・規則正しい間隔で連続している対象物または開口間
3/28	・深さゲージ	5/18	・深さ測定用
3/30	・一對の固定面間の距離が一定のバー、ブロックまたはストリップ、ただし、調整できるものも含む、例：エンドメジャー、フィラーストリップ	5/20	・輪郭または曲率測定用
3/32	・そのためのホルダー	C	形状測定用
3/34	・リングまたはその他の穴あきゲージ、例：" はめあい " ゲージ	D	・内周面の [例：管の内周面]
3/36	・おねじ用	M	曲がり測定用 (曲率半径測定は5/213)
3/38	・オプンヨークと対向面をもち、面間の内部距離が一定しているゲージ、すなわちカリパス、ただし調整できるものも含む	R	真円度、真球度測定用
3/40	・おねじ用	Z	その他のもの
3/42	・リミットゲージ型のもの、すなわち " はめあい式 " (G01B3/40 が優先)	5/207	・複数の固定した同時作動の変換器を使うもの (G01B5/213-G01B5/22 までが優先) [6]
		5/213	・曲率半径測定用 [6]
		5/22	・球面計

5/24 ・角度またはテ - パ測定用；軸の心合せ試験用

5/245 ・垂直の検査用 [6]

5/25 ・軸の心合せ検査用

5/252 ・偏心率測定用，すなわち，二つの平行軸間の偏位 [6]

5/255 ・ホイ - ルの心合せ試験用

5/26 ・面積測定用，例．プラニメ - タ [2006.01]

5/28 ・表面の粗さまたは不規則性測定用

5/28 101 ・平坦度測定用

5/28 102 ・表面粗さ測定用

5/30 ・固体の変形測定用，例．機械的ひずみ計

7/00 電氣的または磁氣的技術の使用によって特徴づけられた測定装置 [2006.01]

S 接触検知プロ - プ (7/012、7/016 が優先)

T ・導通形 (7/012、7/016 が優先)

U 変位測定プロ - プ (7/012、7/016 が優先)

W ・摩耗量の測定

Z その他

7/00 101 ・位置又は移動量の測定

C 静電容量形

R 電気抵抗形

M 磁気形

E ・電磁誘導形 [例．コイルを用いるもの]

F ・渦電流形

H ・感磁性素子を用いるもの [例．ホール素子、MR 素子]

Z その他のもの

7/00 102 ・2 次元位置又は移動量の測定

C 静電容量形

R 電気抵抗形

M 磁気形

Z その他のもの

7/00 103 ・3 次元位置又は移動量の測定

C 静電容量形

R 電気抵抗形

M 磁気形

Z その他のもの

7/004 ・点の座標測定用 [6]

7/008 ・座標測定機械を使うもの [6]

7/012 ・そのための接触子ヘッド [6]

7/016 ・接触子の構造細部 [6]

7/02 ・長さ、幅または厚みの測定用 (G01B7/004、G01B7/12 が優先) [6]

A 周長、曲線に沿った長さの測定

B 高さの測定

J 長さ、幅の測定

Z その他のもの

7/04 ・移動体の長さまたは幅測定用に特に適合したもの

7/04 101 ・移動方向に沿った移動体の長さ測定用

7/06 ・厚み測定用

A 電解形

C 静電容量形

R 電気抵抗形

M 磁気形

Z その他のもの

7/12 ・直径測定用

7/13 ・内径 [6]

7/14 ・離隔対象物または離隔開口間の距離または間隙測定用 (G01B7/30 が優先)

7/15 ・規則的な間隔に置かれたもの [6]

7/16 ・固体の変形測定用，例．抵抗ひずみ計によるもの

C 静電容量形

R 電気抵抗形

Z その他のもの

7/24 ・磁気特性変化を使うもの

7/26 ・深さ測定用

7/28 ・輪郭または曲率測定用

A 形状測定一般 [信号処理回路，方法的なもの，概念的なもの]

D 曲り測定用 (7/293 が優先)

K 真円度、真球度測定用

Z その他のもの

7/287 ・複数の固定した同時動作の変換器を使うもの (G01B7/293 が優先) [6]

7/293 ・曲率半径測定用 [6]

7/30 ・角度またはテ - パ測定用；軸の心合せ試験用

B 角度

D ・静電容量形

G ・電気抵抗形

M ・磁気形

H ・感磁性素子を用いるもの [例．ホール素子、MR 素子]

E テ - パ - (7/305 が優先)

S ・静電容量形

T ・電気抵抗形

U ・磁気形

Z その他のもの

7/305 ・垂直の検査用 [6]

7/31 ・軸の心合せ検査用

7/312 ・偏心率測定用，すなわち，二つの平行軸間の偏位 [6]

7/315 ・ホイ - ルの心合せ試験用

7/32 ・面積測定用 [2006.01]

7/34 ・表面の粗さまたは不規則性測定用

A 不規則性測定用 [例．欠陥の大きさ]

P 走査型顕微鏡を用いるもの [例 .STM]

Z その他のもの

7/34 101 ・平坦度測定用

7/34 102 ・表面粗さ測定用

9/00 光学的技術の使用によって特徴づけられた測定計器 [2006.01]

このグループに分類する場合、特定のパラメータを測定するための光学的装置は、さらにグループ G01B11/00 に分類することができる。

9/02 ・干渉計 [2022.01]

9/02001 ・放射に固有の特性の制御または生成に特徴のあるもの [2022.01]

9/02002 ・2 つ以上の異なる周波数を用いるもの [2022.01]

9/02003 ・ピ - ト周波数を用いるもの [2022.01]

9/02004 ・周波数走査によるもの [2022.01]

9/02015 ・光路の構成に特徴があるもの [2022.01]

9/02017	・・・標的物と光ビ - ム群の間に複数の相互作用があるもの、例、異なる位置から発生するビ - ム反射 [2022.01]		H 撮像手段を利用したもの Z その他
9/02018	・・・マルチパス干渉計、例、ダブルパス干渉計 [2022.01]	11/08	・直径測定用 G 干渉または回折を利用したもの
9/02055	・・・エラ - の低減または防止；試験するもの；校正 [2022.01]		H 撮像手段を利用したもの Z その他のもの
9/02056	・・・エラ - の受動的低減 [2022.01]	11/10	・・・移動体の G 干渉または回折を利用したもの
9/02061	・・・傾きまたは位置ずれによる影響の低減または防止 [2022.01]		H 撮像手段を利用したもの Z その他のもの
9/0209	・・・低コヒ - レンス干渉計 [2022.01]		
9/02091	・・・断層撮影干渉計、例、光学のコヒ - レンスに基づくもの [2022.01]	11/12	・・・内径 G 干渉または回折を利用したもの
9/02097	・・・自己干渉計 [2022.01]		H 撮像手段を利用したもの Z その他のもの
9/02098	・・・シアリング干渉計 [2022.01]		
9/021	・・・ホログラフィ技術によるもの [2]	11/14	・離隔対象物または離隔開口間の距離または間隙測定用（G01B11/26 が優先；光学的距離計 G01C3/00）
9/023	・・・等高線作成用（G01B9/025-G01B9/029 が優先） [2]		G 干渉または回折を利用したもの
9/025	・・・二重露光方式 [2]		H 撮像手段を利用したもの Z その他のもの
9/027	・・・実時間式 [2]		
9/029	・・・時間平均式 [2]	11/16	・固体の変形測定用、例、光学的ひずみ計
9/04	・測定用顕微鏡		G 干渉または回折を利用したもの
9/06	・測定用望遠鏡		H 撮像手段を利用したもの Z その他のもの
9/08	・光投影式コンパレ - タ		
9/10	・複数の面の間の角度測定用ゴニオメ - タ	11/22	・深さ測定用 G 干渉または回折を利用したもの
11/00	光学的技術の使用によって特徴づけられた測定装置 [2006.01]		H 撮像手段を利用したもの Z その他のもの
A	位置、移動量の測定		
B	・光軸方向における測定	11/24	・輪郭または曲率の測定用
C	・光軸直交面内における位置の測定、例、光電顕微鏡によるもの		A 外面の（平面内の形状測定は F） B 内面の D 干渉または回折を利用したもの、ホログラフィ - F 平面内の形状〔プリント基板の配線パターン、紙面上の印刷パターンの形状等〕の R 真円度、真球度 K 撮像手段を利用したもの M 曲り、そり、カ - ル測定用 Z その他のもの
D	・中心位置または偏心量の測定；心出し（11/27 が優先）		
G	干渉または回折を利用したもの	11/245	・・・複数の、固定された、同時に作動する変換器を用いるもの（G01B11/255 が優先） [7]
H	撮像手段を利用したもの		G 干渉または回折を利用したもの H 撮像手段を利用したもの Z その他のもの
Z	その他のもの	11/25	・・・対象物にパターン、例、モアレ縞、を投影することによるもの（G01B11/255 が優先） [7]
このグループに分類する場合、特定の光学的測定計器はさらにグループ G01B9/00 に分類することができる。			G 干渉または回折を利用したもの H 撮像手段を利用したもの Z その他のもの
11/02	・長さ、幅または厚み測定用（G01B11/08 が優先）		
G	干渉または回折を利用したもの		
H	撮像手段を利用したもの		
Z	その他のもの	11/255	・・・曲率半径測定用 [7] G 干渉または回折を利用したもの H 撮像手段を利用したもの Z その他のもの
11/03	・・・点の座標測定によるもの [3]		
G	干渉または回折を利用したもの		
H	撮像手段を利用したもの		
Z	その他のもの	11/26	・角度またはテ - パ測定用；軸の心合せ試験用 G 干渉または回折を利用したもの H 撮像手段を利用したもの Z その他のもの
11/04	・・・移動体の長さまたは幅測定用に特に適合したもの		
G	干渉または回折を利用したもの		
H	撮像手段を利用したもの		
Z	その他のもの	11/27	・・・軸の心合せ検査用
11/04 101	・・・移動方向に沿った移動体の長さ測定用		
G	干渉または回折を利用したもの		
H	撮像手段を利用したもの		
Z	その他のもの		
11/06	・・・厚み測定用		
G	干渉または回折を利用したもの		
H	撮像手段を利用したもの		
Z	その他		
11/06 101	・・・移動体の厚み測定用		
G	干渉または回折を利用したもの		

	G	干渉または回折を利用したもの		K	・画像を取得 [例 .SEM 画像 ,TEM 画像] することによるもの
	H	撮像手段を利用したもの		C	マイクロ波または電波によるもの
11/275	Z	その他のもの		D	蛍光, 回折, 光電子, 波長特性の利用によるもの
		・ホイ - ルの心合せ試験用		Z	その他のもの
	G	干渉または回折を利用したもの	15/04		・輪郭または曲率の測定用
	H	撮像手段を利用したもの		A	X 線または 線の透過, 吸収によるもの
11/28	Z	その他のもの		H	・画像を取得 [例 .CT 画像] することによるもの
		・面積測定用 [2006.01]		B	荷電粒子線によるもの
	A	網点面積		K	・画像を取得 [例 .SEM 画像 ,TEM 画像] することによるもの
	H	撮像手段を利用したもの		C	マイクロ波または電波によるもの
11/30	Z	その他のもの		Z	その他のもの
		・表面の粗さまたは不規則性測定用	15/06		・固体の変形測定用
	A	外面の欠陥	15/08		・表面の粗さ, または不規則性の測定用 [6]
	W	路面の凹凸			・超音波, 音波, または超音波振動の使用によって特徴づけられた測定装置 [2006.01]
	P	近接場光を利用したもの	17/00		
	Z	その他のもの		A	長さ, 幅の
11/30 101		・平坦度, 真直度測定用		B	位置の
11/30 102		・表面粗さ測定用		C	超音波透視装置
	G	干渉または回折を利用したもの		Z	その他のもの
	Z	その他のもの	17/02		・厚み測定用
13/00		流体の使用によって特徴づけられた測定装置 [2006.01]		A	共振型
13/02		・長さ, 幅または厚み測定用 (G01B13/08 が優先)		B	管体の厚み
13/03		・点の座標測定によるもの [3]		C	凝固片の
13/04		・移動体の長さまたは幅測定用に特に適合したもの		D	電磁超音波による
13/06		・厚さ測定用		E	管体内挿型
13/08		・直径測定用		Z	その他のもの
13/10		・内径	17/04		・固体の変形測定用, 例 . 振動弦によるもの
13/12		・離隔対象物または離隔開口間の距離または間隙測定用 (G01B13/18 が優先)			・輪郭または曲率の測定用 [6]
13/14		・深さ測定用	17/06		・表面の粗さ, または不規則性の測定用 [6]
13/16		・輪郭または曲率の測定用	17/08		
13/18		・角度またはテ - パ測定用 ; 軸の心合せ試験用	21/00		測定技術がこのサブクラスの他のグループに包含されない, 特定されていないまたは関連の無い, 測定装置またはその細部 [2006.01]
13/19		・軸の心合せ検査用		A	位置の測定 ; 変位量の測定 ; 移動量の測定 ; 座標の測定
13/195		・ホイ - ルの心合せ試験用		C	・一次元の ; 直線上の
13/20		・面積測定用, 例 . 空気式プランメ - タ [2006.01]		D	・二次元の ; 平面上の
13/22		・表面の粗さまたは不規則性測定用		E	・三次元の ; 空間上の
13/24		・固体の変形測定用 [3]		F	・中心位置, 偏心量の測定 ; 心出し, センタリング用
15/00		電磁波または粒子性放射線の使用によって特徴づけられた測定装置, 例 . マイクロ波, X 線, ガンマ線または電子の使用によるもの (光学的技術の使用によって特徴づけられたもの G01B9/00, G01B11/00) [2006.01]		G	・信号処理に特徴があるもの
	A	X 線または 線の透過, 吸収によるもの		H	測定手段又は測定対象物を搬送, 交換又は回転させるハンドリングシステム
	H	・画像を取得 [例 .CT 画像] することによるもの		L	測定手段又は対象物を支持, 固定するための基台, テ - ブル, 載置台 ; その微動機構
	B	荷電粒子線によるもの		P	位置, 寸法, 形状測定用のプロ - プ (H12.4 新設)
	K	・画像を取得 [例 .SEM 画像 ,TEM 画像] することによるもの		W	摩耗量の測定
	C	マイクロ波または電波によるもの		R	鉄道軌条測定用
	Z	その他のもの		S	鉄道架線測定用
15/02		・厚み測定用		T	路面測定用
	A	X 線または 線の透過, 吸収によるもの		Z	その他のもの
	H	・画像を取得 [例 .CT 画像] することによるもの	21/02		・長さ, 幅または厚さの測定用 (G01B21/10 が優先) [3]
	B	荷電粒子線によるもの			

		A	高さ測定用
		B	曲線に沿った長さ測定用
		C	物体の周囲の長さ測定用
		H	計器様式の装置
		S	スケール、エンコダを有するもの
		Z	その他のもの
21/04			・点の座標測定によるもの [3]
21/06			・移動体の長さまたは幅測定用に特に適合したもの [3]
21/06	101		・移動方向に沿った移動体の長さ測定用
		A	尺取計尺〔一定間隔のマーク付けと検知〕によるもの
		Z	その他のもの
21/08			・厚さ測定用 [3]
21/08	101		・移動体の厚み測定用
21/10			・直径測定用 [3]
21/12			・移動体の [3]
21/14			・内径 [3]
21/16			・離隔対象物間の距離または間隙測定用 [3]
21/18			・深さ測定用 [3]
21/20			・輪郭または曲率測定用、例．プロフィール測定 [3]
		A	曲率、曲り、そり測定用
		C	外周面の
		D	内周面の
		F	二次元、平面パタンの
		G	連続的に移動する物体〔例．鋼板〕の
		H	非連続的に移動する物体〔例．容器〕の
		Z	その他のもの
21/20	101		・三次元測定によるもの（102 が優先、三次元形状測定用のプロブは G01 B21/00P）
21/20	102		・ねじまたは歯車測定用
		S	ねじ測定用
		Z	その他のもの
21/22			・角度またはテパ測定用；軸の心合せ検査用 [3]
21/24			・軸の心合せ検査用 [3]
21/26			・ホイールの心合せ検査用 [3]
21/28			・面積測定用 [2006.01]
21/30			・表面の粗さまたは不規則性測定用 [3]
21/30	101		・平坦度または真円度測定用
		F	平坦度、真直度、測定用
		Z	その他のもの
21/30	102		・表面粗さの測定用
21/32			・固体の変形測定用 [3]